

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Masato Yonezawa et al. Art Unit : Unknown
Serial No. : Unassigned Examiner : Unknown
Filed : April 8, 2002
Title : METHOD OF MANUFACTURING A SEMICONDUCTOR DEVICE

Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT UNDER 35 USC §119

Applicants hereby confirm their claim of priority under 35 USC §119 from the following application:

Japan Application No. 2001-109559 filed April 9, 2001

A certified copy of the application from which priority is claimed is submitted herewith.

Please apply any charges or credits to Deposit Account No. 06-1050.

Respectfully submitted,

Date: April 8, 2002



John F. Hayden
Reg. No. 37,640

Fish & Richardson P.C.
601 Thirteenth Street, NW
Washington, DC 20005
Telephone: (202) 783-5070
Facsimile: (202) 783-2331

日 本 国 特 許 庁

JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 4月 9日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-109559

ST.10/C]:

[JP2001-109559]

出 願 人

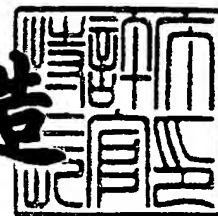
Applicant(s):

株式会社半導体エネルギー研究所

2002年 2月22日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2002-3009608